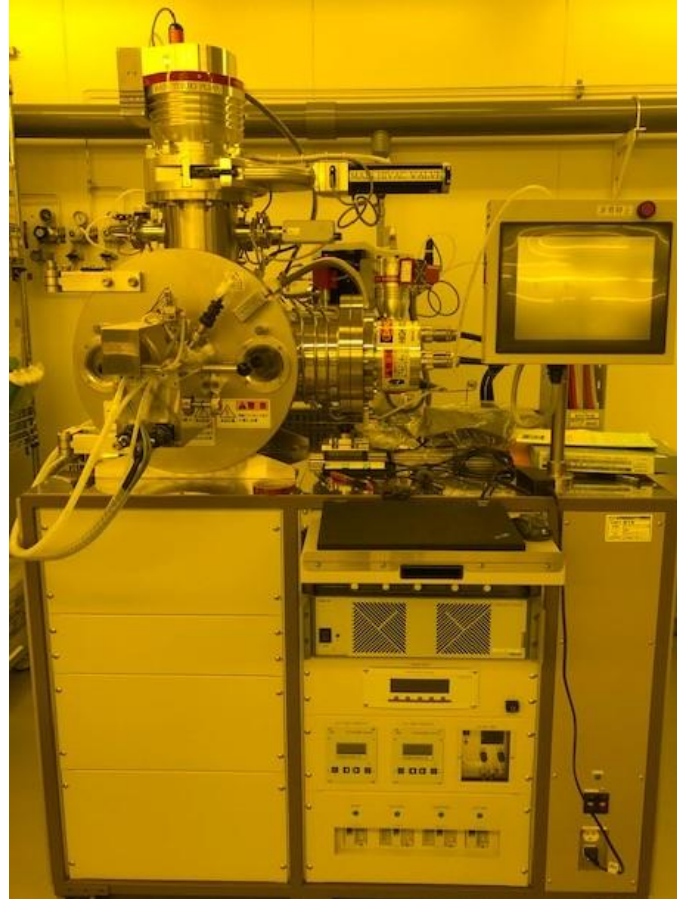


SIMS 付カウフマン型イオンミリング装置

伯東株式会社 IBE-KDC75-EDP-0U-TA



カウフマン型イオン銃を搭載した低損失、低エネルギー、大電流のドライエッチングが可能なミリング装置。SIMS による終点検出機構付き。

イオンビーム電圧：200～900V

イオンビーム電流：100mA

使用ガス：Ar

イオンソース：カウフマン型

試料ステージ：10cm

装置利用料（大学・公的研究機関）：5000 円/時間

装置利用料（民間企業等）：7500 円/時間

その他クリーンルーム入室料などがかかります。

設置場所：産業科学研究所 ナノテク棟 4F- N415

装置担当：先端機器室 佐久間